

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 8 月 28 日 (28.08.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/070623 A1

(51) 国際特許分類:
B81C 5/00, G01N 37/00, B01J 19/00

B81B 1/00,

(ARIKE, Shigeharu) [JP/JP]; 〒308-8521 茨城県 下館市
大字小川1500番地 日立化成工業株式会社 総合研究
所内 Ibaraki (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP03/02066

(22) 国際出願日: 2003 年 2 月 25 日 (25.02.2003)

(74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒105-0001
東京都 港区 虎ノ門一丁目2番3号 虎ノ門第一ビル9
階 Tokyo (JP).

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB,
BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ,
OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ,
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,
ZM, ZW.

(30) 優先権データ:
特願2002-48580 2002 年 2 月 25 日 (25.02.2002) JP
特願2002-292978 2002 年 10 月 4 日 (04.10.2002) JP
特願2003-46414 2003 年 2 月 24 日 (24.02.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化
成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.)
[JP/JP]; 〒163-0449 東京都 新宿区 西新宿二丁目 1 番
1 号 Tokyo (JP).

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許
(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI
特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 河添 宏 (KAWA-
ZOE, Hiroshi) [JP/JP]; 〒308-8521 茨城県 下館市 大字
小川1500番地 日立化成工業株式会社 総合研究所
内 Ibaraki (JP). 中祖 昭士 (NAKASO, Akishi) [JP/JP]; 〒
308-8521 茨城県 下館市 大字小川1500番地 日立化成
工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki (JP). 有家 茂晴

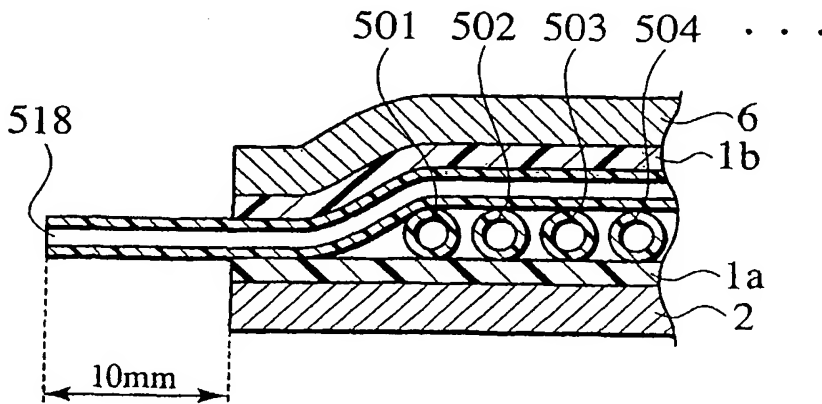
添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受
領の際には再公開される。

[続葉有]

(54) Title: MICRO FLUID SYSTEM SUPPORT UNIT AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(54) 発明の名称: マイクロ流体システム用支持ユニット及びその製造方法



(57) Abstract: A micro fluid system support unit includes a first support body (2), a first adhesive layer (1a) arranged on the surface of the first support body (2), a first hollow filament group consisting of a plurality of hollow filaments (501 to 508) arranged with an arbitrary shape on the surface of the first adhesive layer (1a), a second hollow filament group consisting of a plurality of hollow filaments (511 to 518) arranged in the direction orthogonal to the first hollow filament group, a second adhesive layer (1b) arranged on the surface of the second hollow filament group, and a second support body (6) arranged on the surface of the second adhesive layer (1b). The first and the second hollow filament group constitute a flow passage layer.

[続葉有]

WO 03/070623 A1